观察波导模式及测量薄膜参数用的 对称棱镜光波耦合器

徐 德 维 (中国科学院长春物理所)

A symmetric prizm optical coupler for observing waveguide modes and measuring parameters of thin film

Xu Dewei

(Changchen Institute of Physics, Academia Sinica)

The parameters for waveguide thin film of BaK₂ glass prepared on a substrate of $10 \times 75 \times 2$ mm³ K_{2} glass were measured. The observed values \tilde{N}_{m} are in good agreement with the theoretical ones.

(2)

棱镜光波耦合器是向波导薄膜馈送和取 出光能、选择激发波导模式、精确测量薄膜参 数的重要器件^(1~8)。

图 1 为直角和对称棱镜光波耦合器的略 图。no、n1、n2、n3 分别表示衬底、薄膜、空气 和棱镜的折射率, S 为空气隙宽度。根据全 反射和相干加强条件以及 Snell 定律,可导 出波导模式特征方程及有效折射率为:

 $KW(n_{1}^{2}-N_{m}^{2})$

$$= m\pi + \tan^{-1} \left[\left(\frac{n_1}{n_0} \right)^{2\rho} \left(\frac{N_m^2 - n_0^2}{n_1^2 - N_m^2} \right) \right]^{\frac{1}{2}} + \tan^{-1} \left[\left(\frac{n_1}{n_2} \right)^{2\rho} \left(\frac{N_m^2 - n_2^2}{n_1^2 - N_m^2} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$
(1)
$$f_m = \beta_m / K = \sin \alpha \cos \alpha + \left(n^2 - \sin^2 \alpha \right)^{\frac{1}{2}} \sin \alpha$$

式中 m 表示模式阶数, ρ 表示激光束的偏振 态。对 TE 模式, $\rho=0$; 对 TM 模式, $\rho=1$ 。 β_m 为波导模式传播常数, ε 为棱镜角, α_m 为



收稿日期: 1978年8月23日。

m 阶模式的同步角。(2)式中除了 n1、W之外,其它参数都是可以分别测量的。因为(2) 式是超越方程,所以不可能解析求解,只有通过迭代公式才能近似求解^[5]。

图 2 示出用于观测薄膜 参数的 实验 装置。采用分辨率为6'的测角圆盘。经过偏振 片和透镜的 He-Ne 激光束投射在对 称棱镜 直角面上,使激光束束腰与棱镜基部中心相 重合。把带有棱镜光波耦合器的夹具装在可 调的 *X-Y* 轨道的底座上。通过调节 *X-Y* 向移动旋扭,把耦合器移动到适当位置上,以 便在改变入射激光束方向时耦合光点保持稳 定。为了观察方便,用毛玻璃制作的屏幕做 观察屏。



图 2 观测薄膜参数的实验装置 1-X方向移动旋扭; 2--观察屏; 3--m线; 4--传输条纹; 5--玻璃波导薄膜; 6--夹具; 7--对称耦合棱镜; 8--顶丝; 9--入射偏 振激光束; 10--圆盘

观察发现: (1) m 线中每条线之间的距离 随模式阶数 m 增大而变大; (2) m 线中每条 线的宽度也随模式阶数 m 增大而变宽; (3) 与反射点相交的、表示激发的主模式线条较 亮,表示其它转换模式的线条较弱; (4) m 线 的位置和 m 线的条数随测定样品位置而变 化,由此可获得膜厚分布的规律; (5)引人注 目的是,通过空气隙宽度适当地调整,除了在 屏幕上观察到了 m 线之外(见图 3),在薄膜 中波导模式传输条纹也出现了,如图 4 所示。 相应 m 阶波导模式的特征耦合长度 $L_m = D_m^{-1}e^{2k\sqrt{N_A}-n}$ *随S增大而以指数增长。例如选 S 为 $\frac{\lambda}{10}$, 零阶模式特征耦合长度 L_0 约为 0.18 毫米; 当 S 接近波长 λ 时, L_0 达到了 90

- 44 .



图 3 由高频溅射法制作的 BaK₂ 玻璃薄膜的 m 线 用 m 标记模式阶数, 激发的主模式阶 数为 m=2。共呈现三个波导模式



(a)





图 4 用对称棱镜光波耦合器激发的 BaK₂ 玻璃薄膜的波导模式传输条纹

- (a) m=0 模式的传输条纹;
- (b) m=1模式的传输条纹;
- (c) m=2 模式的传输条纹

		样	品	1		
模式阶数	同步角 _{αm}	$\widetilde{N}_m = \beta_m / K$	$N_m = \beta_m / K$	薄膜折射率 n ₁	薄膜厚度 W(微米)	测量膜厚 相对精度
		观测值	理 论 值			
0	29°4′	$1.5347 \pm 4.7 \times 10^{-4}$	1.53471			
1	28°18′	$1.5288 \pm 4.8 \times 10^{-4}$	1.52878	$1.5367 \pm 5.9 \times 10^{-4}$	3.570	0.036
2	27°6′	$1.5193 \pm 4.9 \times 10^{-4}$	1.51932			1

表1 用 TE 偏振 He-Ne 激光束对 BaK2 玻璃薄膜波导模式的同步角、传播常数的测量

多米。因此,在弱耦合条件下,Lo变得很长。 显然,出现波导模式传输条纹,并不取决于棱 镜的几何形状与薄膜相连接的方式,而取决 于空气隙宽度S的大小。

本文对于尺寸为 $10 \times 75 \times 2$ 毫米³ K₉玻 璃衬底上制作的 BaK₂ 玻璃波导薄膜的参数 进行了测量。由观测可知,对于本实验所测 得的数据,实现了观测值 \tilde{N}_m 与理论值 N_m 比 较好的符合(见表 1)。

要精确测量 n_1 和 W, 主要取决于测量 \tilde{N}_m 和 n_0 的精度。而要测定 \tilde{N}_m , 由(2)式可 见,必须对 n_3 、 ε 和 a_m 进行精确的测量。由 (2)式可给出 \tilde{N}_m 的绝对误差为

 $\Delta \tilde{N}_{m} = \frac{\partial \tilde{N}_{m}}{\partial n_{3}} \Delta n_{3} + \frac{\partial \tilde{N}_{m}}{\partial \varepsilon} \Delta \varepsilon + \frac{\partial \tilde{N}_{m}}{\partial \alpha_{m}} \Delta \alpha_{m}$ (3) 在计算中,采用测量 n_{3} 和 ε 的仪器精度为 $\Delta n_{3} = 5 \times 10^{-5}$ 和 $\Delta \varepsilon = (4.1 \times 10^{-3})^{\circ}$ 。因此, 从整个测量结果来看,同步角 α_{m} 的测量显然 是引入误差的主要来源。为提高测量同步角 的精度,对于每阶模式的同步角都进行了多 次测量,采用均方误差作为测量 α_{m} 精度的标 准($\Delta \alpha_{m} = 3'$)。由 N_{m} 的近似公式

$$N_m = n_1 - \frac{\pi^2 (m+1)^2}{2n_1 (KW)^2} \tag{4}$$

可导出薄膜折射率 n1 的表达式为

$$n_1 = \frac{(m+1)^2 N_i - (i+1)^2 N_m}{(m+1)^2 - (i+1)^2} \qquad (5)$$

式中 *i* 是低于 *m* 的模式阶数。为求 得测量 *n*₁ 的精度, 计算 *n*₁ 的绝对误差 *Δn*₁ 为

$$\Delta n_{1} = \left| \frac{\partial n_{1}}{\partial N_{i}} \right| \Delta N_{i} + \left| \frac{\partial n_{1}}{\partial N_{m}} \right| \Delta N_{m} \qquad (6)$$

对于 TE 模式,由(1)式可导出 W 和 △W/W 分别为

$$W = \left[m\pi + \tan n^{-1} \left(\frac{N_m^2 - n_0^2}{n_1^2 - N_m^2} \right)^{\frac{1}{2}} + \tan n^{-1} \left(\frac{N_m^2 - n_2^2}{n_1^2 - N_m^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right] / K (n_1^2 - N_m^2)^{\frac{1}{2}}$$
(7)
$$\Delta W / W = \left(\left| \frac{\partial W}{\partial t_1} \right| \Delta n_1 + \left| \frac{\partial W}{\partial M_1} \right| \Delta N_m \right) / W$$

$$\Delta W/W = \left(\left| \frac{\partial W}{\partial n_1} \right| \Delta n_1 + \left| \frac{\partial W}{\partial N_m} \right| \Delta N_m \right) / W$$
(8)

由(3)、(6)式计算测量 N_m 、 n_1 的精度高于千 分之一,用(8)式计算测量 W的相对精度 $\Delta W/W$ 为0.036。

综上所述,本测量方法的主要特点是: 快速方便、结构简单、精确可靠,而且是一种 非破坏性测量方法。因此,棱镜光波耦合器 很适用于光学薄膜的测量。其测量精度高于 阿贝折射仪,可与其它干涉法相媲美。可把 它用于外延薄膜、介质薄膜、多种液态薄膜或 薄层等方面的特性研究上。

参考文献

- [1] P. K. Tien et al.; Appl. Phys. Lett., 1969, 14, 291.
- [2] E. Miller; Bell. System. Tech. J., 1969, 48, 2059.
- [3] P. K. Tien et al.; JOSA, 1970, 60, 1325.
- [4] P. K. Tien; Appl. Opt., 1971, 10, 2395.
- [5] R. Ulrich; JOSA, 1970, 60, 1337.
- [6] T. E. Midmirter; IEEE J. Quant. Electr., 1970, QE-6, 583.
- [7] J. Harris; JOSA, 1970, 60, 1007.
- [8] R. Ulrich; JOSA, 1971, 61, 1467.
- [9] R. Ulrich et al.; Appl. Opt., 1973, 10, 2901.

• 45 •